

透過電子顕微鏡による 材料解析の基礎とノウハウ

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 NIMS拠点H25年度設備利用講習会」

【プログラム】

◆午前 (9:40 ~ 12:10)

9:40 開会挨拶 (NIMS 先端的共通技術部門長 藤田大介)

9:50 NIMS 微細構造解析プラットフォームの
TEM 設備群の紹介 (NIMS 竹口雅樹)

10:15 透過型電子顕微鏡の基礎 (NIMS 三石和貴)

10:40 集束イオンビーム (FIB) の加工技術
(AIST 飯竹昌則)

11:05~11:15 休憩

11:15 分析電子顕微鏡及び STEM の基礎
(日本電子(株) 奥西栄治)

11:40 触媒ナノ粒子の高温その場観察 (NIMS 橋本綾子)

12:05 閉会

◆午後 (13:30 ~ 17:00)

装置操作実習 ※12/13(金)までの事前登録が必要です。

実習装置：

JEM-2100F, FEI-Tecnai G²F 30, JIB4000(FIB) など

2013 年

12/19(木)

場所：NIMS 千現地区 第1会議室

主催：NIMS 微細構造解析プラットフォーム

参加費：無料

受付開始：9:20 講演開始：9:40

参加申し込み：

<https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19a2467269147>

関連情報：<http://www.nims.go.jp/nmcp/>

問い合わせ：nmcp@nims.go.jp



※当日参加可能

※資料準備のため、12月13日(金)までの事前登録が望ましいです。

※実習希望者は定員を超えた場合、抽選となります。